

Vorvertrag mit der Siltronic AG zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen

(Aßlar, 24.07.2006) – Die Crystal Growing Systems (CGS) GmbH, Aßlar, eine 100%ige Tochtergesellschaft der PVA TePla AG, Aßlar, hat am 24.07.2006 mit der Siltronic AG, München, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Wacker Chemie AG, einen Letter of Intent über die Lieferung von Kristallzucht-Anlagen in Höhe von rund 60 Mill. Euro geschlossen.

Die Anlagen vom Typ EKZ 3000/450 werden im Rahmen eines Joint Ventures zwischen der Siltronic AG und der Samsung Electronics Co, Ltd. in Singapur zur Herstellung von 300mm Wafern für den Halbleiter-Markt eingesetzt werden. Gegenwärtig findet in der Halbleiter-Industrie ein Systemwechsel von 200mm auf 300mm Wafer statt, den die CGS GmbH mit diesem Anlagentypus unterstützt. Die EKZ 3000 war im Rahmen eines öffentlich geförderten Projektes gemeinsam mit Siltronic entwickelt worden und stellt den neuesten Stand der Technik in der Züchtung von Silizium-Kristallen dar.

Die Kristallzucht-Anlagen werden im Verlaufe der Jahre 2007 und 2008 an das Joint Venture geliefert werden und bilden dort die erste Ausbaustufe der neuen 300mm Wafer-Fabrikation. Der endgültige Vertragsabschluss zwischen der CGS GmbH und der Siltronic AG wird bis zum 30.09.2006 erfolgen.

Dr. Andreas Mühe, Geschäftsführer der CGS GmbH und Leiter des Geschäftsbereiches Kristallzucht-Anlagen der PVA TePla AG, wird Ende August 2006 das Unternehmen verlassen und die Leitung des Bereichs „Crystal Center“ bei der Siltronic AG übernehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dr. Gert Fisahn
PVA TePla AG
Emmeliusstr. 33
35614 Asslar
Phone: +49(0)6441/5692-342